



INVERSION DES DIFFÉRENCES DE MARCHÉ D'UN INTERFÉROMÈTRE À ÉCHELETTES

Procédé innovant de métrologie pour la mesure de différences de chemin optique dans un interféromètre statique

Avantages technologiques

Une technologie performante et innovante

Mesures rapides et fiables
Technologie à haute résolution : précision de l'ordre du nm
Adaptable à tous les domaines spectroscopiques

Une technologie simple et fiable

Utilisation d'un laser simple, non accordable
Pas de déplacement du miroir nécessaire

Synthèse de l'invention

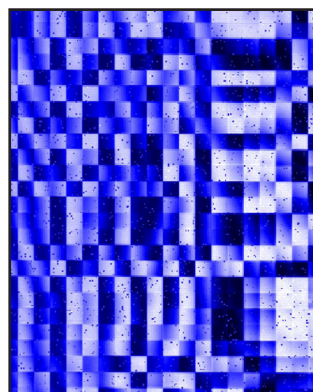
Procédé d'inversion des différences de marche (DDM) pour un interféromètre statique basé sur l'acquisition d'une unique image laser.

Utilisation des corrélations entre les DDM optiques engendrées par la géométrie des miroirs à échelettes, chaque facette étant formée d'une marche « ligne » et d'une marche « colonne ».

Applications potentielles

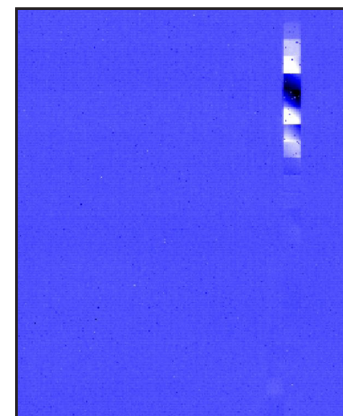
Métrologie d'interféromètre à échelettes à échantillonnage optimisé

Dispositif embarcable, pour plateforme spatiale ou station automatique



Laser

Champ uniforme



Bénéfices commerciaux

Une performance accrue

Mesures rapides, avec une précision élevée
Utilisable pour tout domaine spectral

Un procédé optimisé

Ne nécessite pas de laser accordable
Instrument robuste

Invention brevetée disponible sous licence